【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成16年12月24日(2004.12.24)

【公開番号】特開2001-215524(P2001-215524A)
【公開日】平成13年8月10日(2001.8.10)
【出願番号】特願2000-380646(P2000-380646)
【国際特許分類第７版】
　Ｇ０２Ｆ　1/1345
【ＦＩ】
　Ｇ０２Ｆ　1/1345

【手続補正書】
【提出日】平成16年1月19日(2004.1.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】液晶装置の製造方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面上に電極及び配向膜を形成した第１基板及び第２基板を相互に貼り合わせ、その間に液晶を封止してなり、前記第１基板の一部が前記第２基板よりも外側に張り出す張出部と、前記第１基板に形成された第１導電体と、前記第２基板上の前記第１導電体に対向する部分に形成された第２導電体と、前記第１導電体と前記第２導電体とを導電接続するための導電性粒子を含む導通材とを有する上下導通部を備えた液晶装置の製造方法において、前記第１導電体と前記第２導電体の少なくとも一方の表面を覆うように前記配向膜を延長形成し、前記導通材を介して前記第１基板と前記第２基板とを貼り合わせ、圧着させることによって、前記導電性粒子が前記配向膜を突き破って前記第１導電体と前記第２導電体に導電接触させ、
その後、前記張出部の表面上の配向膜を除去することを特徴とする液晶装置の製造方法。
【請求項２】
請求項１において、前記配向膜の除去は、プラズマアッシングによって除去することを特徴とする液晶装置の製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本発明の液晶装置の製造方法は、表面上に電極及び配向膜を形成した第１基板及び第２基板を相互に貼り合わせ、その間に液晶を封止してなり、前記第１基板の一部が前記第２基板よりも外側に張り出す張出部と、前記第１基板に形成された

第１導電体と、前記第２基板上の前記第１導電体に対向する部分に形成された第２導電体と、前記第１導電体と前記第２導電体とを導電接続するための導電性粒子を含む導通材とを有する上下導通部を備えた液晶装置の製造方法において、前記第１導電体と前記第２導電体の少なくとも一方の表面を覆うように前記配向膜を延長形成し、前記導通材を介して前記第１基板と前記第２基板とを貼り合わせ、圧着させることによって、前記導電性粒子が前記配向膜を突き破って前記第１導電体と前記第２導電体に導電接触させ、その後、前記張出部の表面上の配向膜を除去することを特徴とする。

【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
この発明によれば、導通材中の導電性粒子が配向膜を突き破って第１導電体と第２導電体とを導通させているので、従来のように上下導通部を避けて配向膜を形成する必要がなくなるため、配向膜の外縁位置に対する制約がなくなる結果、液晶装置の表示領域の周囲部分における設計の自由度が高くなることから、当該周囲部分の狭幅化が可能となり、液晶装置の表示領域の拡大と小型化とを両立させることができる。また、上下導通部内の配線等の導電体が配向膜に覆われた状態にすることができるので、上下導通部の耐蝕性を向上させることができる。さらに、配向膜をより広い範囲に形成することができるようになるため、ラビング状態の均一性を高めることが可能になる。また、配向膜の形成工程において配向膜のパターニング（印刷パターンの形成）自体が不要になるとともに、配向膜のラビング処理時においては配向膜が基板を全面的に被覆しているため、ラビングムラを低減できる。

【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】

【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】

【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】

【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】